

# 卓上型電子顕微鏡 (SEM-EDS) 見学会兼観察デモ



真空中で電子ビームを試料に照射することにより、試料表面から発生する反射電子及び特性X線を検出することにより、試料表面の凹凸や元素マッピングを観察することができます。

この度、見学会兼観察デモを開催しますので、お気軽にお越しください。

**日時: 5月18日(水) 13:30 ~ 16:00**

(上記時間帯のご都合の良い時にお越しください)

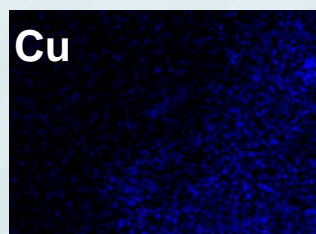
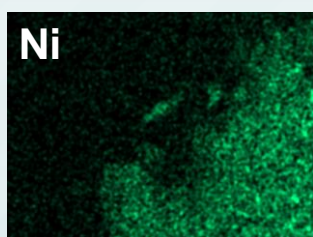
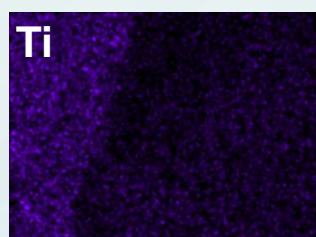
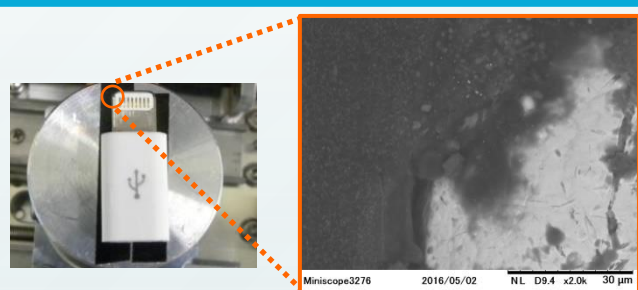
**場所: 理系複合棟 318室**

**装置名: Miniscope® TM3030 + Quantax70  
(日立ハイテクノロジーズ)**

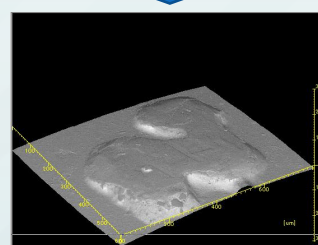
[http://www.hitachi-hightech.com/jp/product\\_detail/?pn=em-tm3030](http://www.hitachi-hightech.com/jp/product_detail/?pn=em-tm3030)

**担当: 泉水 仁 (機器分析支援センター)**

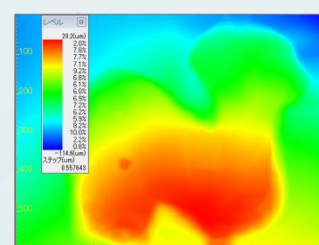
参加申し込みは不要です。但し、観察・分析をご希望の試料をお持ちの方は、事前に相談をお願いします。



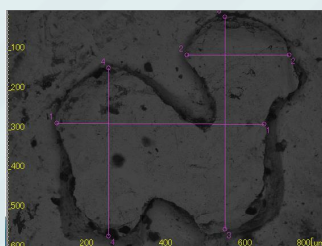
観察例: Lightningケーブル(先端)  
観察条件: 2,000倍、通常(15kV)、  
帯電軽減モード



SEM像



鳥瞰図



2点間距離計測

No.	X(μm)	Y(μm)	Z(μm)	角度(度)
1	522.35	252	522.35	0.26
2	257.29	0.00	257.29	0.00
3	0.00	536.23	536.23	90.00
4	0.00	422.68	422.68	90.00

観察例: 10円玉(裏面の鳳凰)  
観察条件: 200倍、通常(15kV)

問い合わせ先

機器分析支援センター事務室 (理系複合棟307号室) 技術専門職員 泉水仁

TEL: 895-8967 E-mail: [irc@lab.u-ryukyu.ac.jp](mailto:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp) HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>